

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Innovativity To Productivity

PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

普達特科技有限公司*

(於百慕達註冊成立並於開曼群島存續之有限公司)

(股份代號：650)

半導體及太陽能設備業務發展的進展

本公告由普達特科技有限公司*（「本公司」）自願作出，以向本公司股東及有意投資者提供有關本公司最新業務發展的資料。

茲提述本公司日期為二零二五年五月十三日的公告（「該公告」），內容有關半導體及太陽能設備業務的發展情況。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

獲得設備樣機購買訂單

本公司已從一個客戶（「該客戶」）處獲得一台半導體高溫硫酸清洗（「高溫SPM」）設備（「該設備」）的樣機訂單。該設備目前已處於組裝與測試階段，前期已通過客戶的多項工藝性能測試與馬拉松測試，部分指標達到國際領先水平，顯著推進了國產高溫SPM清洗設備打破海外壟斷的進程。該樣機訂單的收入暫未確認。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，該客戶及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

該設備採用高溫SPM清洗工藝，可覆蓋12英寸晶圓關鍵制程的PR-strip、Post-CMP、NiPt remove等多種應用，是業界公認的高難度濕法工藝，市場目前由海外設備供應商壟斷。本公司研發的該設備，具備國內領先、國際一流的高溫控制能

力，可覆蓋至190°C的高溫SPM工藝，經馬拉松驗證，終端工藝腔體高溫硫酸溫控範圍 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，優於主要海外供應商的 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。該設備通過NiPt remove工藝demo測試，在高挑戰性的工況下取得了與國際基準產品對齊的測試結果。該設備在設計方面，採用了化學供液系統與工藝腔室集成化的設計，保證了更大的工藝兼容性與靈活的應用配置，可為客戶提供更具綜合競爭力與性價比的解決方案。

下一階段，本公司將致力於完成該設備的交付與驗證，並擴大客戶在高端應用領域對我們的設備的採用，充分發揮本公司技術團隊在半導體濕法技術方面的優勢，解決行業痛點，提高客戶效率，繼續推動高端半導體設備國產化。

一般事項

樣機訂單項下擬進行的交易並無構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章項下本公司的須予公佈交易。本公司將適時另行刊發公告(如需)。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
普達特科技有限公司*
主席兼首席執行官
劉二壯

香港，二零二五年七月二十三日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名為執行董事，即劉二壯博士(主席)、譚嶠先生及劉知海先生；兩名為非執行董事，即曹霄輝先生及林鈺凱先生；及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、周承炎先生及王國平先生。

* 僅供識別